

BECAS INSTITUCIONALES ACADÉMICA DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20203mc122	Ingeniería en Mecatrónica	60%
			I20173PI046	Ingeniería Industrial	60%
			I20173MC244	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20153mt001	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
			20203mc071	Mecatrónica área Automatización	50%
			20203MC097	Ingeniería en Mecatrónica	70%
			20193MC140	Ingeniería en Mecatrónica	60%
			20203pi048	Procesos Industriales área manufactura	50%
			20193mc137	Mecatrónica área Automatización	60%
			20193mc122	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20173MC218	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20203PI015	Procesos Industriales área manufactura	60%
			20193mc166	Mecatrónica área Automatización	50%
			I20173NT011	Ingeniería en Nanotecnología	60%
			20203mc108	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20193NT021	Nanotecnología área Materiales	60%
			20203mc117	Ingeniería en Mecatrónica	60%
			20193pi053	Procesos Industriales área manufactura	60%
			I20173MC147	Ingeniería en Mecatrónica	70%
			20193MC198	Mecatrónica área Automatización	60%

20193nt020	Nanotecnología área Materiales	70%
I20173mc099	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20193pi039	Procesos Industriales área manufactura	50%
20193pi047	Procesos Industriales área manufactura	50%
i20173mc039	Ingeniería en Mecatrónica	70%
I20183NT016	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20193mc124	Ingeniería en Mecatrónica	60%
20193mc092	Mecatrónica área Automatización	60%
I20173MC126	Ingeniería en Mecatrónica	70%
I20183MC048	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173MT074	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
20203mc090	Ingeniería en Mecatrónica	60%
20193mc057	Ingeniería en Mecatrónica	60%
20203mc025	Mecatrónica área Automatización	60%
20203mc132	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc122	Ingeniería en Mecatrónica	60%
I20183MC082	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC088	Mecatrónica área Automatización	50%
20203mc103	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	60%
20203MC038	Mecatrónica área Automatización	70%
20193mc077	Mecatrónica área Automatización	60%
I20183mc053	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20193mc124	Mecatrónica área Automatización	60%

20193mc034	Mecatrónica área Automatización	50 %
I20173mt053	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
2019061	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20203MC099	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC062	Mecatrónica área Automatización	70%
20203mc008	Mecatrónica área Automatización	60%
I20183pi066	Ingeniería Industrial	70%
I20173pi043	Ingeniería Industrial	60%
I20183PI018	Ingeniería Industrial	60%
20193pi080	Procesos Industriales área manufactura	50%
20193mc016	Mecatrónica área Automatización	70%
20193mc032	Mecatrónica área Automatización	70%
I20173MT015	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20203MC138	Ingeniería en Mecatrónica	60%
20193PI062	Procesos Industriales área manufactura	60%
I20182MC002	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173MC169	Ingeniería en Mecatrónica	70%
20193mc023	Mecatrónica área Automatización	70%
I20173NT001	Ingeniería en Nanotecnología	70%
20203pi066	Procesos Industriales área manufactura	60%
20203mc058	Ingeniería en Mecatrónica	60%
20193MC198	Mecatrónica área Automatización	60%

	I20183MC168	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	20173mt043	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	60%
	I20173nt033	Ingeniería en Nanotecnología	60%
	I20173nt048	Ingeniería en Nanotecnología	70%
	I20173MC126	Ingeniería en Mecatrónica	70%
	I20151MC017	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	20203MC138	Ingeniería en Mecatrónica	60%

BECAS INSTITUCIONALES SOLVENCIA DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20203mt115	TSU en Mantenimiento	50%
			20203mt016	TSU en Mantenimiento	50%
			20203MT094	TSU en Mantenimiento	50%
			20193mt106	TSU en Mantenimiento	50%
			20193mt008	TSU en Mantenimiento	50%
			20203mc054	TSU en Mecatrónica área	50%
			20203mc205	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193mc045	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193mc058	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193MC047	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193mc061	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193mc064	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193mc066	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193mc083	TSU en Mecatrónica área	50%
			20193nt005	TSU en Nanotecnología	50%
			20193nt035	TSU en Nanotecnología	50%
			20203pi004	TSU en Procesos	50%

20203pi005	TSU en Procesos	50%
20203pi007	TSU en Procesos	50%
20203pi012	TSU en Procesos	50%
20203pi022	TSU en Procesos	50%
20203pi037	TSU en Procesos	40%
20203PI040	TSU en Procesos	50%
20203pi064	TSU en Procesos	50%
20203PI069	TSU en Procesos	50%
20203pi071	TSU en Procesos	50%
20203PI088	TSU en Procesos	50%
20193pi003	TSU en Procesos	50%
20193pi020	TSU en Procesos	50%
201930i009	TSU en Procesos	50%
20193pi025	TSU en Procesos	50%
20193pi072	TSU en Procesos	50%
20183pi073	TSU en Procesos	50%
20183mt068	Ingeniería en Mantenimiento	50%
20183mt072	Ingeniería en Mantenimiento	50%
20173mt120	Ingeniería en Mantenimiento	50%
20173mc005	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20183nt047	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20173nt033	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20173pi051	Ingeniería Industrial	50%
20173pi052	Ingeniería Industrial	50%
20153pi024	Ingeniería Industrial	50%
20173pi058	Ingeniería Industrial	50%
20203mc122	TSU en Mecatrónica área	50%
20203mc178	TSU en Mecatrónica área	50%
20193mc015	TSU en Mecatrónica área	50%
20193mc071	TSU en Mecatrónica área	50%

	20183mc176	TSU en Mecatrónica área	50%
	20193mc060	TSU en Mecatrónica área	50%
	20183mc230	TSU en Mecatrónica área	50%
	20203nt027	TSU en Nanotecnología	50%
	20193nt011	TSU en Nanotecnología	50%
	20203pi036	TSU en Procesos	50%
	20193pi084	TSU en Procesos	50%
	20183pi087	TSU en Procesos	50%
	20183mt086	Ingeniería en Mantenimiento	50%
	20153mt071	Ingeniería en Mantenimiento	50%
	20163mt061	Ingeniería en Mantenimiento	50%
	20173mc166	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	20173mc073	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	20173mc072	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	i20153mc150	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	20183nt040	Ingeniería en Nanotecnología	50%
	20173nt021	Ingeniería en Nanotecnología	50%
	20173pi073	Ingeniería Industrial	50%
	20153mt001	Ingeniería Industrial	50%
	20173pi011	Ingeniería Industrial	50%

BECAS INSTITUCIONALES DEPORTIVA DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20193mt009	Mantenimiento área Industrial	60%
			20193mt015	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	60%
			20193mt026	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%

	20193nt043	Ingeniería en Nanotecnología	70%
	I20173MC073	Ingeniería en Mecatrónica	60%
	I20173mt011	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	60%
	I20173mt040	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	60%
	I20173nt066	Ingeniería en Nanotecnología	70%
	20193NT028	Nanotecnología área Materiales	70%
	i20183MC207	Ingeniería en Mecatrónica	60%
	I20183pi053	Ingeniería Industrial	70%
	I20173MC101	Ingeniería en Mecatrónica	60%
	20193nt034	Ingeniería en Nanotecnología	70%
	I20173mt028	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
	20183pi055	Ingeniería Industrial	60%
	i20183mc112	Ingeniería en Mecatrónica	60%

BECAS INSTITUCIONALES CULTURAL DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20193mt072	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
			I20183mt117	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
			I20183MC046	Ingeniería en Mecatrónica	70%
			20193mc005	Ingeniería en Mecatrónica	70%
			20193mc027	Ingeniería en Mecatrónica	70%
			i20183mt090	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%
			I20183MC067	Ingeniería en Mecatrónica	70%

	20193pi001	Procesos Industriales área manufactura	70%
	20193mc083	Ingeniería en Mecatrónica	70%
	20173mt090	Procesos Industriales área manufactura	70%
	I20183mt011	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	70%

BECAS INSTITUCIONALES PROYECTOS DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20183MC188	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20173mc060	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20193mc115	Mecatrónica área Automatización	50%
			20193mc022	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20193mc149	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20183MC042	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20193mc201	Mecatrónica área Automatización	50%
			I20173MC010	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20183MC192	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I2018MC026	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20193mc120	Mecatrónica área Automatización	50%
			I20173mc023	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20173mc254	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20183MC165	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20183MC121	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			I20183MC145	Ingeniería en Mecatrónica	50%

	20193mc166	Mecatrónica área Automatización	50%
	20193mc088	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	I20173mc197	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	I20173MC111	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	I20173MC012	Ingeniería en Mecatrónica	50%
	I20173MC064	Ingeniería en Mecatrónica	50%

BECAS INSTITUCIONALES FAMILIAR/TRABAJADOR DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20203mc064	Ingeniería en Mecatrónica	75%
			20203MT006	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	75%

BECAS INSTITUCIONALES PUEBLOS INDÍGENAS DAMI



Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	Matrícula	Carrera	Porcentaje %
			20183mc079	Ingeniería en Mecatrónica	50%
			20203mc011	Ingeniería en Mecatrónica	50%